# P型张应变 Si/SiGe 量子阱红外探测器的能带设计\*

邓和清1 林桂江1 赖虹凯1 李 成1 陈松岩1,\* 余金中1,2

(1 厦门大学物理系 厦门大学半导体光子学研究中心,厦门 361005)(2 中国科学院半导体研究所 集成光电子国家重点实验室,北京 100083)

摘要:提出 p 型张应变 Si/SiGe 量子阱红外探测器(QWIP)结构,应用 k · p 方法计算应变 Si/SiGe 量子阱价带能带结构和 应变 SiGe 合金空穴有效质量.结果表明量子阱中引入张应变使轻重空穴反转,基态为有效质量较小的轻空穴态,因此 p 型 张应变 Si/SiGe QWIP 与 n 型 QWIP 相比具有更低的暗电流;而与 p 型压应变或无应变 QWIP 相比光吸收和载流子输运 特性具有较好改善.在此基础上讨论了束缚态到准束缚态子带跃迁型张应变 p-Si/SiGe QWIP 的优化设计.

关键词: 张应变; 锗硅量子阱; 红外探测器; PACC: 7360F; 7320D 中图分类号: TN215 文献标识码: A 文章编号: 0253-4177(2008)04-0785-04

## 1 引言

量子阱红外探测器(quantum well infrared photodetector, QWIP) 最早于 1987 年由 Levine 等人<sup>[1]</sup> 用 GaAs/AlGaAs 量子阱作为有源区制成.由于半导体中 的电子有效质量比空穴有效质量小,以电子作为载流子 具有较好的红外吸收和输运特性,目前常用的QWIP器 件通常采用 n 型材料,基于 n 型 QWIP 焦平面阵列制成 的成像系统,已应用于国防、工业、医疗等方面,并不断 向大面阵、高温、双色或多色方向发展.但n型QWIP暗 电流偏大,而且根据量子力学跃迁选择定则,它对垂直 入射光的吸收是很弱或禁戒的.这样在量子阱焦平面探 测器制备中,需要采用复杂的光栅结构来耦合入射光, 增加了制备的难度和成本.而p型QWIP具有能对正入 射光响应的特点,这一优势引起了人们研究 p 型 QWIP 的热潮.对于p型QWIP,其量子阱价带的基态一般为 重空穴能级,以重空穴作为载流子可以有效减小暗电 流;但载流子有效质量大导致较小的吸收系数,这直接 影响着红外探测器的响应度.为解决这一矛盾,Xie等 人<sup>[2]</sup>在1991年提出用应变来使重轻空穴态反转,以轻 空穴为基态,能有效增强子带跃迁的光吸收系数,1993 年 Wang 等人<sup>[3]</sup>使用 p 型掺杂的 InGaAs/InAlAs/InP 量子阱,通过在 InGaAs 中引入张应力,使基态转为轻 空穴态,制作的QWIP在实现低暗电流的同时增强了光 吸收.

然而,III-V 族化合物制作的光电器件与已经广泛 应用的硅微电子工艺不兼容,不能同硅读出电路实现单 片集成.而 SiGe/Si 材料体系与成熟的硅工艺兼容、成 本低.并且在 Si(001)上生长的 SiGe 量子阱中的势阱主 要落在价带上,垂直方向的子带间吸收已经在 p 型 Si/SiGe 量子阱的价带中观察到<sup>[4.5]</sup>.这类探测器可直接作在 Si-CCD 读出电路上,实现光电子器件的单片集成. 随着 Si 基 SiGe 合金材料生长和器件应用的研究,p 型 Si/SiGe QWIP 将展示出更加诱人的前景.

基于以上分析,本文提出在 p 型 Si/SiGe 量子阱中 引入张应变构成 QWIP 结构,并利用 k · p 方法计算应 变 Si/SiGe 量子阱价带各空穴能级的本征能量及其波 函数平方,分析量子阱空穴能级随阱宽和组分的变化规 律,并计算应变 SiGe 合金空穴有效质量,在此基础上设 计出满足束缚态到准束缚态型子带跃迁的 p 型张应变 SiGe QWIP 能带结构.

# 应变 Si/Si<sub>1-x</sub>Ge<sub>x</sub>/Si 量子阱的能带计 算与设计

多带  $k \cdot p$  方法是目前计算半导体价带在极值附近 能带结构及其有效质量常用的理论和方法<sup>[6~8]</sup>,通过求 解一维 Schrödinger 方程、Poisson 方程,自洽计算得到 量子阱(IV 族主族材料 Si,Ge,SiGe 和所有 III-V 族主 族材料)的子带能量本征值及能带的色散关系,在计算 材料  $\Gamma$ 点附近的能带结构上是相对准确的.本文关注的 是 p 型 Si/SiGe 应变量子阱,只考虑顶端 6 个价带能态 的相互作用(包含重空穴、轻空穴和自旋轨道耦合相互 作用),因此使用 6×6  $k \cdot p$  方法计算空穴能带结构是 足够的.本文对应变 Si/Si<sub>1-x</sub>Ge<sub>x</sub>/Si 的能带结构计算是 借助 nextnano<sup>3</sup> 软件完成的.计算分两步完成,第一步, 使用单带的 Schrödinger 方程计算量子阱结构的势及 其准费米能级;第二步,用 6×6  $k \cdot p$  方法计算量子阱 空穴态的本征能量及波函数<sup>[9,10]</sup>.

<sup>\*</sup>国家自然科学基金(批准号:50672079,60336010,60676027)和国家重点基础研究发展规划(批准号:2007CB613400)资助项目

<sup>\*</sup> 通信作者.Email:sychen@xmu.edu.cn 2007-09-17 收到,2007-11-11 定稿



图 1 Si/SiGe/Si 量子阱价带各空穴能量本征值及其波函数平方 (a)压 应变 Si/Si<sub>0.7</sub>Ge<sub>0.3</sub>/Si 量子阱;(b)张应变 Si/Si<sub>0.55</sub>Ge<sub>0.45</sub>/Si 量子阱 虚线 为带边,实线为能量本征值及波函数平方,带箭头虚线表示束缚态到准束 缚态跃迁.

Fig. 1 Valence-subband structure of a compressive strained Si/Si\_{0.7}Ge\_{0.3}/Si quantum well (a) and a tensile strained Si/Si\_{0.55}Ge\_{0.45}/Si quantum well (b) Dotted lines show the band edge, the solid lines show the eigenvalues and wave functions (squared), and the dashed vertical arrows show bound-to-quasibound transitions in the quantum well.

计算结果如图 1 所示,图中给出了应变 SiGe 量子 阱重空穴、轻空穴和自旋分裂轨道的带边,由轻、重空穴 所构成的两套子能级的能量本征值及其波函数的平方.图 1(a)为 Si/Si<sub>0.7</sub>Ge<sub>0.3</sub>/Si 的能带结构,阱宽为 3nm,该 结构 SiGe 合金处于压应变,其基态为重空穴态 HH1.图 1(b)为构建在 Si<sub>0.5</sub>Ge<sub>0.5</sub> 赝衬底上的张应变 Si/Si<sub>0.55</sub>-Ge<sub>0.45</sub>/Si 量子阱,阱宽为 8nm.

可见张应变使得轻/重空穴带边在势阱和势垒中都 发生分离,如图1(b),而对于压应变锗硅,轻/重空穴带 边在Si势垒中仍是简并的,如图1(a)所示.而且张应变 使轻空穴态上移,重空穴下移,轻重空穴发生反转,基态 变为轻空穴LH1.对于应变SiGe量子阱来说,有着不 同总角动量的子能级之间相互耦合,使得能量分布呈非 抛物线型,使一般的选择定则不再适用.在布里渊带的 中央,耦合为零,只有同一个能级类型的子带跃迁可以 发生,并且两个状态的包络函数奇偶性要相反.远离布 里渊带的中心,不同能级类型间的跃迁也被允许,特别 是两个包络函数的奇偶性相同的子能级之间也可以发 生跃迁.因此,图中带箭头虚线所示HH1-HH2,LH1-LH2的跃迁都可以发生,激发态被优化在带边,满足束



图 2 张应变 Si/SiGe 量子阱空穴能量本征值随阱宽和组分的变化 (a) 构建在 Si<sub>0.5</sub>Ge<sub>0.5</sub> 赝衬底上 Si/Si<sub>0.55</sub>Ge<sub>0.45</sub>/Si 量子阱空穴能量本征值随 阱宽的变化; (b)构建在 Si<sub>0.5</sub>Ge<sub>0.5</sub> 赝衬底上的 Si/Si<sub>1-x</sub>Ge<sub>x</sub>/Si(0.25<x <0.48)量子阱空穴能量本征值随 Ge 组分的变化 阱宽为 8nm. Fig. 2 Four lowest subband energies and LH band offset versus well width in tensile strained Si/Si<sub>0.55</sub>Ge<sub>0.45</sub>/Si quantum well grown upon a relaxed Si<sub>0.5</sub>Ge<sub>0.5</sub> buffer layer (a); (b) Four lowest subband energies and LH band offset versus Ge content x in a 8nm tensile strained Si/Si<sub>1-x</sub>Ge<sub>x</sub>/Si quantum well grown upon

a relaxed  $Si_{0.5}$  Ge<sub>0.5</sub> buffer layer Dashed vertical arrows show possible bound-to-quasi-bound transitions in the quantum well.

#### 缚态到准束缚态跃迁型 QWIP 能带优化设计要求.

量子阱中能级位置的确定是获得量子阱红外探测 器其他设计参数的基础,通过调节阱宽、全宽以及 SiGe 合金中 Ge 的组分等参数,可调节阱中各子带能级的位 置,从而为 Si/SiGe QWIP 能带的优化设计提供依据. 这里以 Si<sub>0.5</sub>Ge<sub>0.5</sub>为赝衬底,计算张应变 Si/Si<sub>1-x</sub>Ge<sub>x</sub>/Si 量子阱各空穴本征能量随阱宽和组分的变化关系,能量 以 SiGe 势阱轻空穴带边为参考零点,结果如图 2 所示, 曲线是图示数据点拟合的结果.图 2(a)是在 Ge 组分不 变的情况下,随着阱宽的增加,各空穴能级向着阱底移 动,阱中能限制的空穴态增多;图2(b)给出的是阱宽为 8nm时,SiGe量子阱各空穴态能量本征值随Ge组分x 的变化关系.可见在阱宽不变的情况下,随着 Ge 含量 的增加,阱中限制的空穴态也增多.图中带箭头的虚线 标示着满足束缚态(基态)到准束缚态型子带跃迁相应 的阱宽和组分,其中 LH-HH(如图 2(a)中阱宽约为 2.5nm LH1-HH1 和 6.5nm LH1-HH2;图(b)组分约为 0.35nm LH1-HH1 和 0.41nm LH1-HH2)为不同能级 类型间的子带跃迁可以吸收正入射光,LH-LH(如图

Table 1 Material parameters used for calculation in this paper 参数 单位 Si Ge 0.54304 0.56579 晶格常数 a nm 价带顶 Ev eV 1.090 1.670 静压形变势 a, eV 2.05 -2.86 eV 切应变势 b -2.10-0.35Luttinger 参数 γ1  $\hbar^{2}/2m_{0}$ 4.930 14.38  $\hbar^{2}/2m_{0}$ 0.345 4.24  $\gamma_2$  $\hbar^{2}/2m_{0}$ 5 69  $\gamma_3$ 1.427弹性模量  $C_{11}$ GPa 165.77 128.53  $C_{12}$ GPa 63.93 48.26  $C_{44}$ GPa 79.62 66.80 eV 自旋分裂能 △ 0.044 0.289

表1 数值计算中用到的材料参数

(a)中 7nm 左右 LH1-LH2,图(b)组分约为 0.42 LH1-LH2)为同一个能级类型的子带跃迁可吸收非正入射光.

# 3 应变对 SiGe 合金空穴有效质量的影响

应变是调整半导体能带参数的有效方法之一,在量子阱激光器、调制器、探测器等中有重要的应用.在量子阱中引入应变,可以降低空穴有效质量,加强轻重空穴相互耦合作用,增强 p型 QWIP 的子带吸收.

本文根据 Chao 等人<sup>[6]</sup> 给出的推导结果((1)式), 求解应变 SiGe 合金带边第一空穴态有效质量.

 $\frac{m_{\rm HH,\perp}^{*}}{m_{\rm o}} = \frac{1}{\gamma_{\rm 1} - 2\gamma_{\rm 2}}, \frac{m_{\rm HH,\parallel}^{*}}{m_{\rm o}} = \frac{1}{\gamma_{\rm 1} + \gamma_{\rm 2}}$  $\frac{m_{\rm LH,\perp}^{*}}{m_{\rm o}} = \frac{1}{\gamma_{\rm 1} + 2f_{\rm +}\gamma_{\rm 2}}, \frac{m_{\rm LH,\parallel}^{*}}{m_{\rm o}} = \frac{1}{\gamma_{\rm 1} - f_{\rm +}\gamma_{\rm 2}}$ (1)

其中  $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$  为价带的 Luttinger 参数;  $f_+$  是无量纲 的应变依赖因子<sup>[6]</sup>.

目前,Si,Ge和Si<sub>1-x</sub>Ge<sub>x</sub>合金材料参数的选取没有统一标准,不同的实验测量和理论计算给出的结果有所不同,本文计算中选取的Si,Ge材料参数列于表1<sup>[9]</sup>.对于Si<sub>1-x</sub>Ge<sub>x</sub>合金,其Luttinger参数与Si,Ge材料的Luttinger参数关系由文献[11]给出,其他材料参数均由Si和Ge的相应参数按Ge组分x做线性插值得到.

应变 SiGe 合金带边第一空穴态有效质量计算结果 如图 3 所示,在 Si(001)上生长的 SiGe 为压应变,基态 为重空穴,平行和垂直方向空穴有效质量如图 3(a)所示;在 Si<sub>0.5</sub>Ge<sub>0.5</sub>(001)赝衬底上的 SiGe(x < 0.5)为张应 变,基态为轻空穴,平行和垂直方向空穴有效质量如图 3(b)所示,其中  $m_0$  是自由电子质量.

吸收系数可表示为[12]:

$$\alpha = \rho_{\rm s} N_{\rm T} \, \frac{e^2 \, h}{4 c \varepsilon_0 \, n_{\rm r} \, m^*} f \, \frac{\cos^2 \theta}{\sin \theta} \cos^2 \phi \tag{2}$$

其中  $\rho_s$ 是阱中二维空穴气密度,正比于二维空穴态密 度<sup>[13]</sup>; $D_{2D} = m_{\parallel}/\pi\hbar^2$ ; $m^*$ 为沿生长方向的有效质量;  $N_T$ 为量子阱个数; $n_r$ 为折射率; $\theta$ 为入射角; $\Phi$ 为入射 电矢量的极化角;f为跃迁振子强度.结合(2)式和图 3



图 3 应变 SiGe 合金带边第一空穴态有效质量同 Ge 组分的关系 (a) 在 Si(001)上生长的 SiGe 合金;(b)构建在 Si<sub>0.5</sub> Ge<sub>0.5</sub>(001)赝衬底上的 SiGe 合金 下标  $\| n \perp$ 分别表示平行和垂直于外延层 xy 平面.

Fig. 3 Calculated band-edge masses for the top most valence band in strained  $Si_{1-x} Ge_x$  alloys grown upon Si (001) substrates (a) and  $Si_{1-x} Ge_x$  alloys grown upon a relaxed  $Si_{0.5} Ge_{0.5}$  (001) substrates (b) Parallel ( $\parallel$ ) and perpendicular ( $\perp$ ) to the *xy* plane

可知,与压应变 SiGe 相比,张应变 SiGe 沿生长方向的 有效质量  $m_{\perp}$ 明显变小;平面有效质量  $m_{\parallel}$ 变大,增大 态密度,这两者能有效增强光吸收.计算结果表明,p型 Si/SiGe 量子阱实现了轻、重空穴反转,具有潜在的应用 价值.

### 4 结论

本文提出 p 型张应变 Si/SiGe QWIP 结构,应用 k · p方法计算应变 Si/SiGe 量子阱价带能带结构和应 变 SiGe 合金空穴有效质量.该结构可实现轻重空穴反 转,以轻空穴为基态,增强材料的光吸收.并以 Si<sub>0.5</sub> Ge<sub>0.5</sub>作为赝衬底,分析了张应变 Si/Si<sub>1-x</sub>Ge<sub>x</sub>/Si 量子阱 各空穴本征能量随阱宽和组分的变化关系,给出了具体 设计参数,适用于 p 型 Si/SiGe QWIP 的优化设计.

### 参考文献

- [1] Levine B F, Bethea C G, Hasnain G, et al. High-detectivity  $D^* = 1.0 \times 10^{10}$  cm (Hz)<sup>1/2</sup>/W GaAs/AlGaAs multiquantum well  $\lambda = 8.3 \ \mu$ m infrared detector. Appl Phys Lett, 1988, 53:296
- [2] Xie H, Katz J, Wang W I. Infrared absorption enhancement in light- and heavy-hole inverted Ga<sub>1-x</sub>In<sub>x</sub>As/Al<sub>1-y</sub>In<sub>y</sub>As quantum wells. Appl Phys Lett, 1991, 59:3601

- $\begin{bmatrix} 3 \end{bmatrix}$  Wang Y H, Li S S, Chu J, et al. Ultralow dark current p-type strained-layer InGaAs/InAlAs quantum well infrared photodetector with background limited performance for  $T \leq 100$ K. Appl Phys Lett, 1994, 64:727
- [4] Park J S.Karunasiri R P G, Wang K L. Normal incidence infrared detector using p-type SiGe/Si multiple quantum wells. Appl Phys Lett, 1992, 60:103
- $\begin{bmatrix} 5 \end{bmatrix}$  People R, Bean J C, Bethea C G, et al. Broadband  $(8-14\mu m)$ , normal incidence, pseudomorphic Ge<sub>x</sub>Si<sub>1-x</sub>/Si strained-layer infrared photodetector operating between 20 and 77K. Appl Phys Lett, 1992,61:1122
- Chao C Y P, Chuang S L. Spin-orbit-coupling effects on the valence-band structure of strained semiconductor quantum wells. Phys Rev B,1992,46(1):4110
- [7] Ikonic Z, Harrison P, Kelsall R W. Self-consistent energy balance simulations of hole dynamics in SiGe/Si THz quantum cascade structures. J Appl Phys, 2004, 96:6803
- [8] Liu Y X, Ting D Z Y, McGill T C. Efficient, numerically stable multiband k p treatment of quantum transport in semiconductor

heterostructures. Phys Rev B, 1996, 54(11):5675

- [9] Lin Guijiang, Zhou Zhiwen, Lai Hongkai, et al. Energy band design for Si/SiGe quantum cascade laser. Acta Physica Sinica, 2007,56(7):4137 (in Chinese)[林桂江,周志文,赖虹凯,等.Si/ SiGe 量子级联激光器的能带设计.物理学报,2007,56(7):4137].
- [10] Lin Guijiang, Lai Hongkai, Li Cheng, et al. Energy band design for terahertz Si/ SiGe quantum cascade laser. Chinese Journal of Semiconductors, 2006, 27(5):916(in Chinese)[林桂江,赖虹凯,李 成,等.太赫茲 Si/SiGe 量子级联激光器的能带设计.半导体学报, 2006, 27(5):916]
- [11] Rieger M, Vogl P. Electronic-band parameters in strained  $Si_{1-x}$ -Ge<sub>x</sub> alloys on  $Si_{1-y}$  Ge<sub>y</sub> substrates. Phys Rev B, 1993, 48 (19): 14276
- [12] Karunasiri R P G, Park J S, Wang K L. Intersubband absorption in SiGe Si multiple quantum wells. Appl Phys Lett, 1990, 57:2585
- [13] Strong R, Misra R, Greve D W. GeSi infrared detectors I. Absorption in multiple quantum well and heterojunction internal photoemission structures. J Appl Phys, 1997, 82:5191

## An Energy Band Design for p-Type Tensile Strained Si/SiGe Quantum Well Infrared Photodetectors<sup>\*</sup>

Deng Heqing<sup>1</sup>, Lin Guijiang<sup>1</sup>, Lai Hongkai<sup>1</sup>, Li Cheng<sup>1</sup>, Chen Songyan<sup>1,†</sup>, and Yu Jinzhong<sup>1,2</sup>

(1 Department of Physics, Semiconductor Photonics Research Center, Xiamen University, Xiamen 361005, China)

(2 State Key Laboratory on Integrated Optoelectronics, Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100083, China)

Abstract: Quantum well infrared photodetectors (QWIPs) offer numerous potential applications for defense.industry, and medicine. A novel p-type tensile strained Si/SiGe QWIP is proposed in this paper. The valence band structure of the strained Si/SiGe quantum well and hole effective mass of the strained SiGe alloy are calculated using the  $k \cdot p$  method. When tensile strain is induced in the quantum wells, the light-hole state with small effective mass becomes the ground state, which is expected to have lower dark current than n-type QWIPs and also have larger absorption coefficient and better transport characteristics than conventional unstrained or compressive strained p-type QWIPs. Designs for p-type tensile strained Si/SiGe QWIP based on the bound-to-quasi-bound transitions are also discussed.

Key words: tensile strained layer; Si/SiGe quantum well; infrared detector PACC: 7360F; 7320D Article ID: 0253-4177(2008)04-0785-04

<sup>\*</sup> Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Nos.50672079,60336010,60676027), and the State Key Development Program for Basic Research of China (No.2007CB613400)

<sup>†</sup> Corresponding author. Email: sychen@xmu. edu. cn

Received 17 September 2007, revised manuscript received 11 November 2007